

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】平成25年8月8日(2013.8.8)

【公表番号】特表2013-500869(P2013-500869A)

【公表日】平成25年1月10日(2013.1.10)

【年通号数】公開・登録公報2013-002

【出願番号】特願2012-522914(P2012-522914)

【国際特許分類】

B 2 4 D 11/00 (2006.01)

B 2 3 K 26/36 (2006.01)

B 2 3 K 26/00 (2006.01)

【F I】

B 2 4 D 11/00 Q

B 2 3 K 26/36

B 2 3 K 26/00 G

B 2 3 K 26/00 N

【手続補正書】

【提出日】平成25年6月19日(2013.6.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被覆研磨物品であって、

裏材に固定された研磨層であって、該研磨層が、少なくとも1種の結合剤によって、該裏材の第1の主表面に固定される研磨粒子を含む、研磨層と、  
前記研磨層の少なくとも一部に配置されるスーパーサイズと、を含み、

前記被覆研磨物品が、前記被覆研磨物品の縁部に隣接する溶融流れゾーンを有し、該溶融流れゾーンが、100マイクロメータ未満の最大幅を有し、該溶融流れゾーンが、40マイクロメータ未満の最大高さを有する、被覆研磨物品。

【請求項2】

少なくとも1種の結合剤によって裏材の第1の主表面に固定される研磨粒子を含む被覆研磨物品を用意することと、

前記被覆研磨物品の第1の構成要素に対応する第1の吸収スペクトルの少なくとも一部を得ることと、

前記第1の吸収スペクトルの第1の吸光帯と一致する第1の波長を有する第1の赤外線レーザービームを用意することであって、前記第1の構成要素は、前記被覆研磨物品の厚さの1マイクロメートル当たり少なくとも0.01である、第1の波長における第1の吸光度を有することと、

前記第1の構成要素の一部を、前記第1の赤外線レーザービームでアブレーションすることと、を含む方法。

【請求項3】

少なくとも1種の結合剤によって裏材の第1の主表面に固定される研磨粒子を含む被覆研磨物品を用意することと、

第1の波長を有する第1の赤外線レーザービームを用意することとであって、前記被覆研磨物品は、第1の構成要素の厚さの1マイクロメートル当たり少なくとも0.01であ

る、前記第1の波長における第1の吸光度を有する第1の構成要素を有することと、

前記第1の構成要素の一部を、前記第1の赤外線レーザービームでアブレーションすることと、

前記第1の波長と異なる第2の波長を有する第2の赤外線レーザービームを用意することであって、前記被覆研磨物品は、第2の構成要素の厚さの1マイクロメートル当たり少なくとも0.01である、前記第2の波長における第2の吸光度を有する第2の構成要素を有することと、

前記第2の構成要素の一部を、前記第2の赤外線レーザービームでアブレーションすることと、を含む方法。